

受賞歴一覧（集積化 MEMS 技術研究会）

2024 年 5 月 31 日現在

開催日	イベント	賞	受賞者	受賞組織	タイトル
2024 年 11 月 14 日 - 16 日	第 14 回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	為村 成亨, 峰尾 圭忠, 新井 俊希, 宮川 和典, 杉山 睦, 難波 正和	NHK 放送技術研究所, 東京理科大学	電荷増機能有する結晶セレン膜積層型 8K 個体撮像デバイスの研究
		研究奨励賞	高瀬 駿	名古屋大学	MEMS デバイスを利用した Ni 基薄膜金属ガラスの内部応力測定
		研究奨励賞	仲野 翔	豊橋技術科学大学	スペクトルイメージングに向けたフィルタフリー分光センサ作製のためのエピタキシャル基板を用いた基礎検討
		優秀ポスター賞	Devi Srujana Tenneti, Kisuke Miyado, Akira Onishi, Tatsuhiko Mori, Katsuyuki Machida, Tomoyuki Kurioka, Tso-Fu Mark Chang, Masato Sone, Yoshihiro Miyake and Hiroyuki Ito	Tokyo Institute of Technology	A Study on Warpage of Perforated Proof-mass on Gold Single-Axis MEMS Accelerometer for Micro-g Level Sensing
2023 年 8 月 2 日	第 14 回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	研究奨励賞	井出 智也	豊橋技術科学大学	フィルタフリー波長センサによる複数波長の同時イメージング
		優秀ポスター賞	為村 成亨, 後藤 正英, 佐藤 弘人	NHK 放送技術研究所	フレキシブル CMOS イメージセンサの回路特性評価と凹面形成プロセスの開発
2022 年 8 月 3 日	第 13 回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	大西 哲	東京工業大学	微弱筋音測定のための高感度 MEMS 加速度センサモジュールの検討
2022 年 2 月 10 日	第 12 回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	阪上 天斗 1, 太田 宏之 2, 藤枝 俊宣 3, 崔容俊 1, 野田 俊彦 1, 澤田 和明 1, 高橋 一浩 1	1 豊橋技術科学大学, 2 防衛医科大学校, 3 東京工業大学	神経伝達物質の多項目検出に向けた光干渉型 MEMS 表面応力センサの作製と評価
2021 年 11 月 9 日 - 11 日	第 13 回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	本間 浩章, 池野 翔, 年吉 洋	東京大学	エレクトレット帯電/陽極接合同时プロセスによる MEMS 型振動発電素子
		優秀論文賞	前澤 宏一, 森 雅之	富山大学	周波数 Δ 変調方式変位センサを用いた AFM/表面粗さ計の可能性
		研究奨励賞	水本 昂宏	京都大学	周波数変調型加速度センサを用いた MEMS リザバーコンピューティング
2021 年 1 月 28 日	第 11 回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	霜降 真希, 平井 義和, 土屋 智由	京都大学	MEMS を用いた単結晶シリコンへき開面ナノギャップ
		優秀ポスター賞	金森 亮人, 崔容俊, 瀧 美樹, 野田 俊彦, 澤田 和明, 高橋 一浩	豊橋技術科学大学	オンチップ非標識バイオセンシングに向けた CMOS-MEMS 光干渉表面応力センサの製作
2020 年 10 月 26 日 - 28 日	第 12 回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	安東 伽奈子 1, 山本 崇史 1, 前田 祐作 1, 3, 藤原 理郎 2, 高尾 英邦 1, 3	1 香川大学, 2 高松赤十字病院, 3 JST-CREST	低摩擦状態下での内視鏡治療に向けた鉗子実装型 MEMS 滑り覚センサ
		優秀論文賞	町田 俊太郎, 田中 宏樹, 南 利光	日立製作所	MUT 型音響メタマテリアルの作製と音響特性の評価
		研究奨励賞	高橋 利昌	豊橋技術科学大学	神経伝達物質の非標識検出に向けた分子インプリント法による MEMS 光干渉型表面応力センサの作製と評価
		研究奨励賞	本間 浩章	東京大学	ダブルデッキ構造とジャンパ配線を一体化したエレクトレット MEMS 振動発電素子

2019年11月19日 - 11月21日	第11回集積化MEMSシンポジウム	優秀論文賞	日暮 栄治 1, 東 颯人 2, 山本道貴 2, 松前 貴司 1, 倉島 優一 1, 高木 秀樹 1, 須賀 唯知 3	1 産業技術総合研究所, 2 東京大学, 3 明星大学	チタン薄膜を用いたウェハ常温接合 - キャップ層とナノシリコン層の導入 -
		優秀論文賞	本間 浩章, 年吉 洋	東京大学	ダブルデッキ構造による MEMS 振動発電素子の小型化
		研究奨励賞	中島 翼	香川大学	60μN の摩擦力感度と 0.5μm の空間分解能を有するナノ領域触覚センサの製作と評価
		研究奨励賞	古賀 達也	東京工業大学	微弱筋音計測に向けた高分解能 MEMS 慣性センサモジュールの検討
2019年7月26日	第10回集積化MEMS技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	綿谷 一輝, 寺尾 京平, 下川房男, 高尾 英邦	香川大学	アレイ型高分解能2軸触覚センサを用いた触覚分布情報の計測と評価
2019年5月10日	第13回集積化MEMS研究会				
2018年10月30日 - 11月1日	第10回集積化MEMSシンポジウム	優秀論文賞	吉村 武 1, 荒牧 正明 1, 村上修一 2, 佐藤和郎 2, 藤村 紀文 1	1 大阪府立大, 2 大阪産技研	BiFeO ₃ スパッタ膜を用いた圧電 MEMS 振動発電
		優秀論文賞	本田 悠葵 1, 後藤 正英 1, 渡部 俊久 1, 難波 正和 1, 井口義則 1, 更屋 拓哉 2, 小林 正治 2, 日暮 栄治 2, 年吉 洋 2, 平本俊郎 2	1 NHK 放送技研, 2 東京大学	SOI ウェハの直接接合を用いた2層積層 320x240 画素並列 CMOS イメージセンサ
		研究奨励賞	田中 佐和子	豊橋技術科学大学	フォトゲート型蛍光センサによるレジオナラ属菌の識別可能性の検討
		研究奨励賞	金子 美泉	日本大学	小型ランキンサイクルのためのMEMSタービン発電機の開発
		優秀ポスター賞	丸山 智史, 金森 亮人, 高橋一浩, 澤田 和明	豊橋技術科学大学	光干渉型表面応力センサアレイのための抗体塗り分け手法の検討
2018年5月31日 - 6月1日	第2回台湾-日本国際交流シンポジウム(第12回集積化MEMS技術研究会, 第9回集積化MEMS技術研究ワークショップ)	優秀ポスター賞	Hiroaki Honma 1, Hiroyuki Mitsuya 2, Gen Hashiguchi 3, Hiroyuki Fujita 1, Hiroshi Toshiyoshi 1	1 University of Tokyo, 2 Saginomiya Seisakusho Inc., 3 Shizuoka University	Power Density Enhancement of Electret Based Energy Harvester with Symmetric Comb-Electrode Structure
		優秀ポスター賞	Yuki Honda 1, Masahide Goto 1, Toshihisa Watabe 1, Kei Hagiwara 1, Masakazu Nanba 1, Yoshinori Iguchi 1, Takuya Saraya 2, Masaharu Kobayashi 2, Eiji Higurashi 2, Hiroshi Toshiyoshi 2, and Toshiro Hiramoto 2	1 NHK Science and Technology Research Laboratories, 2 The University of Tokyo	Three-Layer Stacked Au/SiO ₂ Hybrid Bonding with 6-μm-Pitch Au Electrodes for 3D Structured Image Sensors
		優秀ポスター賞	Wan-Ting Chiu 1, Chun-Yi Chen 1, Tso-Fu Mark Chang 1, Tomoko Hashimoto 2, Hiromichi Kurosu 2, Masato Sone 1	1 Tokyo Institution of Technology, 2 Nara Women's University	Co-Deposition of Ni-P and TiO ₂ on Silk Textile by Supercritical CO ₂ Promoted Electroless Plating for Gas Sensor Applications

2017年10月31日 - 11月2日	第9回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	本間 浩章 1, 三屋 裕幸 2, 橋口 原 3, 藤田 博之 1, 年吉 洋 1	1 東京大学, 2 鷲宮製作所, 3 静岡大学	左右対称構造により静電拘束力を抑制した低 G 用の MEMS 振動発電素子
		優秀論文賞	浅野 翔 1, 室山 真徳 1, 中山貴裕 2, 畑 良幸 3, 田中 秀治 1	1 東北大学, 2 トヨタ自動車, 3 豊田中央研究所	センサプラットフォーム LSI と貫通配線 LTCC 基板を用いた集積化指先センサの作製とアクティブセンシングによる材質識別の実証
		研究奨励賞	大西 脩平	豊橋技術科学大学	フォトゲート型蛍光センサを用いたレジオネラの蛍光観測
		研究奨励賞	谷口 嘉昭	徳島大学	ホスホリルコリン修飾グラフェンのタンパク質吸着特性
		優秀ポスター賞	山下 貴士, 中野 大輔, 森 雅之, 前澤 宏一	富山大学	新規 MEMS 位相シフタを用いた広帯域可変周波数共鳴トンネルダイオード発振器
		優秀ポスター賞	小西 敏文 1, 山根 大輔 2, 佐布 晃昭 1, 曾根 正人 2, 年吉洋 3, 益 一哉 2, 町田 克之 2	1 NTT アドバンステクノロジー, 2 東京工業大学, 3 東京大学	積層メタル技術を用いた MEMS 慣性センサの構造設計のための粘性定数モデルの検討
2017年7月26日	第8回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	綿谷 一輝, 寺尾 京平, 下川房男, 高尾 英邦	香川大学	高分解能 2 軸触覚センサにおける対象表面と微細接触子間の接触解析
2016年10月24日 - 26日	第8回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	井上 匡志, 村上 歩, 堀本 恭弘, 内田 雄喜, 笠井 隆	オムロン株式会社	等価回路解析を利用した高 SNR・広帯域マイクロフォンの設計
		優秀論文賞	森山 雅昭, 鈴木 裕輝夫, 熊野 勝文, 戸津 健太郎, 平野栄樹, 田中 秀治	東北大学	厚い Au 膜の面内高周波フィードスルーを用いた Au-Au 接合気密封止 MEMS パッケージング技術
		研究奨励賞	鈴木 孝典	東北大学	ポリイミドフィルムと薄膜配線を用いた集積型 OCXO チップのパッケージ内空中実装技術の開発
		研究奨励賞	竹内 雅耶	兵庫県立大学	免疫測定のための高精度単位化学操作を実現する Lab-on-a-CD の提案
2016年7月26日	第7回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	前澤 宏一, 角谷 祐一郎, 田近 拓巳, 森 雅之	富山大学	周波数 $\Delta\sigma$ 変調方式を用いた共鳴トンネル歪センサ
		優秀ポスター賞	Liao Kaiwei 1, Hou Max T. 2, Yeh J. Andrew 1	1National Tsing Hua University, 2National United University	Liquid-based tactile sensor with tunable sensitivity for dynamic shear force sensing
		優秀ポスター賞	北岡 誠, 永濱 拓也, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫	徳島大学	SiC 上グラフェンのシート抵抗の湿度依存性
		研究奨励賞	前田 祐作	香川大学	基準面構造を持つ生体硬さセンサにおける荷重依存性低減の理論的検証
2016年5月20日	第10回集積化 MEMS 技術研究会				
2015年10月28日 - 30日	第7回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	後藤 正英 1, 萩原 啓 1, 井口義則 1, 大竹 浩 1, 更屋 拓哉 2, 小林 正治 2, 日暮 栄治 2, 年吉洋 2, 平本 俊郎 2	1NHK 放送技術研究所, 2 東京大学	画素並列信号処理を行う SOI 積層型 3 次元構造撮像デバイスの試作と評価
		優秀論文賞	ムサ アハマド, 美濃谷 直志, 松永 賢一, 近藤 利彦, 森村 浩季	NTT 先端集積デバイス研究所	A Programmable Sensor-Independent Readout Circuit for Trillion Sensors Era
		研究奨励賞	岡部 謙志	豊橋技術科学大学	埋め込み神経インターフェイスに向けた低侵襲フレキシブルレクテナの開発
		研究奨励賞	西村 祐典	豊橋技術科学大学	マイクロ流路内でのレジオネラ属菌のストレス応答
2015年7月31日	第6回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	為村 成亨, 宮川 和典, 大竹浩, 久保田 節	NHK 放送技術研究所	結晶セレンヘテロ接合ダイオードを用いた積層型イメージセンサの開発
		研究奨励賞	高安 基大	東京工業大学	MEMS 慣性センサを用いた移動体制御の検討

2015年5月15日	第9回集積化 MEMS 技術研究会				
2014年10月20日 - 22日	第6回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	後藤 正英 1, 萩原 啓 1, 井口義則 1, 大竹 浩 1, 更屋 拓哉 2, 日暮 栄治 2, 年吉 洋 2, 平本俊郎 2	1 NHK 放送技術研究所, 2 東京大学	21pm2-c3 : 画素並列信号処理を行う撮像デバイスの実現に向けた 3 次元集積回路の試作と評価
		研究奨励賞	橋上 護	立命館大学	22am2-c6 : 流体可変平面キャパシタにおける静電容量可変率の評価
		研究奨励賞	長谷川 浩章	日立製作所	22pm1-c4 : 積層構造のスクレーピング設計による CMUT の周波数特性の制御
2014年7月11日	第5回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	優秀ポスター賞	西村 祐典 1, 林 隆平 1, 中澤 寛一 1, 石田誠 1, 澤田 和明 1, 石井仁 1, 町田 克之 2, 3, 益一哉 2, 王 常楽 4, 飯田健一郎 4, 齋藤 光正 4, 吉田 真一 4	1 豊橋技術科学大学, 2 東京工業大学, 3 NTT-AT, 4 九州大学	マイクロビーズと PDMS 製マイクロ流路を用いたレジオネラ菌捕獲チップの検討
		優秀ポスター賞	大山 光司, 柿田直輝, 宮下英俊, 李相錫	鳥取大学	バイオマーカーの吸着体としてカーボンナノチューブを用いたマイクロ予備濃縮器の設計及び性能評価
2014年5月29日 - 30日	第8回集積化 MEMS 技術研究会				
2013年11月5日 - 7日	第5回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	柄崎 将寛, 熊谷 慎也, 佐々木 実	豊田工業大学	マイクロ流体界面へのシート状反応性プラズマ形成の検証
		奨励賞	早坂 丈	東北大学	L S I 集積化アンペロメトリックセンサレイへの導電性ダイヤモンド電極の形成
		奨励賞	小島 貴裕	東北大学	L S I をダイヤフラムとする集積化触覚センサの作製
2013年7月26日	第4回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	ポスター賞	黒田 真二郎, 鈴木 健一郎	立命館大学	Fishbone 型 MEMS 共振器の周波数可変特性の評価
2013年5月24日	第7回集積化 MEMS 技術研究会				
2012年10月23日 - 24日	第4回集積化 MEMS シンポジウム	優秀論文賞	小西 敏文, 丸山 智史, 三田信, 山根 大輔, 伊藤 浩之, 町田 克之, 石原 昇, 益 一哉, 藤田博之, 年吉 洋		ハードウェア記述言語を用いた集積化 CMOS-MEMS 統合設計技術
		研究奨励賞	森田 翔伍		垂直配向シリコンワイヤーのフォースセンサ型バイオプローブ応用
2012年7月20日	第3回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ				
2012年5月18日	第6回集積化 MEMS 技術研究会				
2011年5月20日	第5回集積化 MEMS 技術研究会				
2010年10月14日 - 15日	第2回集積化 MEMS シンポジウム				
2010年7月9日	第2回集積化 MEMS 技術ワークショップ	ポスター賞	関 洋文, 高橋和巳, 橋本秀樹	東レリサーチセンター	TSV, MEMS デバイスの評価技術
		ポスター賞	山崎智幸, 池田貴昭, 石田誠, 澤田和明	豊橋技術科学大学	集積化電気化学測定チップの設計と製作
		ポスター賞	山本翔司, 北村隆二, 鈴木健一郎	立命館大学	サブミクロン狭ギャップを有する集積化 MEMS スイッチの開発
		ポスター賞	堀内 幸男, 金 行洲	ピーアイ技術研究所	感光性高耐熱性樹脂を用いた MEMS キャップの接合技術
2010年1月21日	第4回集積化 MEMS 技術研究会				

2009年10月16日	第26回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 集積化 MEMS シンポジウム	奨励賞	丸山 智史 1, 三田 信 2, 藤田博之 3, 年吉 洋 3	1 東京大学工学系研究科, 2 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部, 3 東京大学 生産技術研	電気回路シミュレータ Qucs を用いた集積化 MEMS のための連成解析手法
		奨励賞	望月 俊輔, 水田 千益	(株)数理システム	MEMSpice – 回路シミュレーション技術を用いた電気 - 機械連成解析ツール
		奨励賞	小此木 孝仁 1, 興津 輝 2, 寺尾 京平 3, 鈴木 孝明 3, 大岡正孝 1, 小寺 秀俊 4	1 JST CREST, 2 京都大学付属病院, 3 香川大学 工学部, 4 京都大学大学院 工学研究科	任意の細胞へ薬剤刺激を与えることができるデバイスの構築
		優秀論文賞	島村 俊重 1, 森村 浩季 1, 下山 展弘 1, 阪田 知巳 1, 重松智志 1, 町田 克之 2, 中西 衛 1	1 NTT(株), 2 NTT-AT(株)	容量型指紋センサ LSI における不正検出のためのインピーダンス検出手法
2009年7月14日	第1回 集積化 MEMS 技術研究ワークショップ	ポスター賞	赤井 大輔 1, 澤田 和明 1-3, 石田 誠 2, 3	1 豊橋技術科学大学 VBL, 2 豊橋技術科学大学 電気・電子工学系, 3 JST CREST	エピタキシャル γ -Al ₂ O ₃ /Si 基板を用いた Si 集積化強誘電体薄膜デバイス
2009年5月22日	第3回 集積化 MEMS 技術研究会				
2008年11月21日	第2回 集積化 MEMS 技術研究会				
2008年7月10日	第1回 集積化 MEMS 技術研究会兼発足会				